アバランシェ型超伝導ナノワイヤ単一光子検出素子の特性評価

Characterization of superconducting nanowire avalanche single photon detector

情通機構, ⁰三木 茂人,山下 太郎,寺井 弘高

NICT, °S. Miki, T. Yamashita, H. Terai

E-mail: s-miki@nict.go.jp

1. はじめに

超伝導ナノワイヤ単一光子検出器(SSPD)は、高感度、低暗計数率、かつ高い時間分解能を有する光 子検出器として、様々な応用研究分野で用いられている。SSPDにおいて、高検出効率化を図る為の方 針として、低いエネルギーギャップを有した超伝導薄膜ナノワイヤの適用やナノワイヤの狭線化が考 えられるが、いずれの場合も超伝導ナノワイヤの臨界電流値が従来よりも減少する為、信号対雑音比 が悪化し、時間分解能が劣化してしまう。この問題を解決する事の出来る構造として、アバランシェ 型超伝導ナノワイヤ光子検出素子(Superconducting Nanowire Avalanche Photon detector: SNAP)が提案さ れている[1]。N-SNAP は超伝導ナノワイヤが N 個並列に配置された受光部と、ナノワイヤ受光部にア バランシェ現象を引き起こすためのインダクタ部(L_b)から構成され、同線幅の従来型 SSPD 構造に比べ て N 倍の出力電圧が得られる。この時、N が大きいとナノワイヤ受光部のアバランシェ現象は起こり づらいが、N=2 程度であればアバランシェ現象を引き起こすことは比較的容易となる。そこで今回は、 2 本のナノワイヤが並列配置された 2-SNAP 素子の作成と性能評価を行ったので報告する。

2. 実験結果

2-SNAP 素子は、SiO₂ 熱酸化膜(膜厚 240 nm)付 Si 基 板上に成膜された膜厚 5 nm の NbTiN 薄膜を用い、ナノ ワイヤ受光部(線幅:80 nm、間隙:80 nm、サイ ズ:15µm×15µm)と、ナノワイヤインダクタ部(線幅:300 nm、間隙:300 nm、サイズ:15µm×60µm)が形成された。 また、ナノワイヤ受光部の上部には、SiO(250nm)、 Ag(100nm)による光キャビティ構造が付加されている。 2-SNAP 素子は極小レンズを用いた高光結合パッケー ジに実装され[2]、GM 冷凍機システム(動作温度 2.2K) により冷却された。図 2 にλ=1550nm における、SSPD 素子の検出効率および暗計数率のバイアス電流依存性 を示す。作製された 2-SNAP 素子はスイッチング電流 Iswが、24.5 µAと従来型SSPD素子(Isw:10~14 µA程度[3]) に比べて高い値を示し、これまでよりも高いバイアス 電流(Ib)を付加する事が可能である事を確認した。また、 Ib ~22µA 付近で検出効率が既に飽和傾向にあり、暗計 数率が数カウント/秒と低いにも関わらず、75%以上の システム検出効率の取得に成功した。本研究は JSPS 科 研費(課題番号25286077)の助成により行われた。



図 2.2-SNAP 素子の検出効率、暗計数率のバイアス 電流依存特性

[1]M. Ejrnaes 他, APL 91, 262509, 2007 [2] S. Miki 他, Otp. Lett., 35, 2133, 2010 [3] S. Miki 他, IEICE J97-C, 10, 357, 2014